펨토초 레이저의 합성파를 이용한 절대 거리 측정

*진종한 ¹, 김영진, 김윤석, 김승우

KAIST BUPE 연구단

Absolute length metrology using synthetic wavelength of a femtosecond pulse laser

*J. Jin¹, Y.-J. Kim, Y. Kim, S.-W. Kim

¹ Billionth Uncertainty Precision Engineering(BUPE) group, KAIST,

Key words: absolute length metrology, femtosecond pulse laser, synthetic wavelength interferometer

1. 서론

절대 거리 측정은 한번의 측정 과정을 통해 기준면과 측정면 사이의 거리를 얻어내는 방법이다. 기존의 거리 및 각도 측정에서 널리 사용되고 있는 이종 모드 HeNe 레이 저(heterodyne HeNe laser)는 측정면을 움직이면서 간섭 무늬 를 계수하여, 측정면의 초기 위치와 최종 위치 사이의 상 대 변위(relative displacement)를 측정하는 대표적인 방법이다. 이는 측정 분해능을 nm 이하로 얻을 수 있고 빠른 속도로 측정할 수 있기 때문에 초정밀 위치 결정 및 제어용으로 널리 사용되고 있다. 하지만 수 m 이상의 긴 거리를 측정 할 때 측정면을 초기 위치에서 측정하고자 하는 위치까지 연속적으로 움직이면서 간섭 무늬를 계수하여야만 하기 때 문에 공기의 유동, 진동 등의 외부 요인에 의해 측정하는 동안 간섭 신호를 잃어버리게 되면 처음부터 다시 측정해 야만 하는 단점이 있다. 이런 단점들은 높은 분해능으로 긴 영역의 길이 측정을 필요로 하는 항공/우주 산업에서의 궤도 추적 및 결정, 초대형 건축물의 건설 작업, 초대형 선 박의 조립 및 건조 등의 중공업, 첩보 위성에 적용될 고해 상도 카메라의 제작 및 검사나 유도 미사일 궤도 추적 등 의 국방 기술에 적용하기에는 실질적으로 한계가 있다. 향 후 우리나라의 첨단 및 국방 기술 경쟁력 확보를 위해서는 이러한 산업들에 대한 기초 기술들이 활발히 연구 및 개발 되어야 하며, 그 중에서도 초정밀 측정을 위한 절대 거리 측정 기술이 필수적으로 확보되어야 한다.

절대 거리 측정 기술은 크게 여러 개의 파장을 통해 절 대 거리를 얻을 수 있는 다파장 간섭계(multi-wavelength interferometer)의 원리[1], 빛의 주파수 혹은 파장을 천이시 키거나 끌기를 바탕으로 하는 파장 천이 및 끌기 간섭계 (wavelength scanning/sweeping interferometer), 비슷한 주파수 를 갖는 두 개 혹은 그 이상의 주파수 성분들의 간섭을 통 하여 위상의 모호성을 피하기 위해 주기가 긴 여러 합성파 를 생성함으로써 절대 거리를 측정하는 합성파 간섭계 (synthetic wavelength interferometer)로 나눌 수 있다. 본 논문 에서는 펨토초 레이저의 광 빗(optical comb)의 주파수 모드 들 간 간섭을 통해 최대 수 m 에서 최소 수백 mm 에 해당 하는 여러 합성파를 생성하여 절대 거리 측정에 이용하는 합성파 간섭계의 원리를 기본으로 하여 절대 거리 측정을 수행하고자 한다. 현재까지 연구가 진행된 펨토초 레이저 의 광 빗을 기본으로 하는 합성파 간섭계의 경우에는 수 m 의 측정영역에서 수 μm 정도의 분해능으로 측정 가능하 다. 이 때, 측정영역은 펨토초 레이저 광 빗의 주파수 모드 간 간격(repetition rate)과 전자 회로의 대역폭(bandwidth)에 의해 제한되며 측정 분해능은 기준 파(reference wave)와 측 정 파(measurement wave) 사이의 위상 차(phase difference)를 검출하는 위상 검출기(phase-meter)의 성능에 의해 좌우된다. 75 MHz 의 주파수간 모드를 갖는 펨토초 레이저를 사용한 선행연구에서는 최대 측정 영역이 4 m 이고, 측정 분해능은 8.55 µm 이었다[2].

본 연구에서는 펨토초 레이저의 주파수 간 모드를 변화 시킴으로써 더 넓은 측정 영역을 갖고, 동시에 위상 검출 77

기를 통한 위상 측정 분해능보다 훨씬 높은 성능을 갖는 위상 잠금(phase locking) 개념을 도입함으로써 최대 60 m 의 측정 영역에서 nm 이하의 측정 분해능을 갖는 절대 거리 측정 방법을 제안하고자 한다.

2. 기본 이론 및 구성

펨토초 레이저는 발진 대역폭 내에 105~ 106 개의 독립 적인 주파수 모드(repetition rate, f,)들을 갖는다. 이 주파수 모드들은 각 주파수 모드들 간의 간섭을 통해 식(1)과 같은 합성파, Λ 를 생성하게 된다. 이렇게 생성된 합성파를 사용 하여 기준 신호와 측정 신호의 위상 차, $\Delta \phi$ 를 검출하게 되면 식(2)와 같이 절대 거리, L을 선정할 수 있다.

$$\Lambda = \frac{c}{f_r} \tag{1}$$

$$L = \frac{c}{2\pi f_r} \cdot \Delta \phi \tag{2}$$

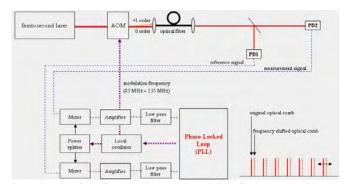


Fig. 1 Schematics of synthetic wavelength interferometer based on the concept of phase locking for absolute length metrology

그림 1 은 위상 잠금 개념을 이용하여 수십 m 의 측정 영역에서 nm 이하의 분해능으로 절대 거리 측정이 가능한 광학 구성도이다. 80 MHz 의 주파수 모드간 간격을 갖는 펨 토초 레이저에서 나온 빛은 주파수 천이(frequency shift)를 위해 AOM(Acousto-Optic Modulation)에 입사된다. AOM 에 입사된 빛은 원래의 입사된 빛과 5 MHz ~ 75 MHz 만큼 주 파수 천이된 1 차 회절 빛을 생성하며, 이 두 빛을 광섬유 에 집광시켜 간섭시킨다. 이를 통하면 원래의 주파수 모드 간 간격인 80 MHz 에 해당하는 합성파와 그 조화파 성분 및 주파수 천이된 빛과 원래의 빛이 간섭되어 나타나는 5 MHz ~ 75 MHz 사이에 해당하는 합성파를 얻을 수 있다. AOM 을 통한 주파수 천이 방법은 펨토초 레이저의 공진기 의 끝 미러(end mirror)를 PZT 로 구동하여 구현할 수 있는 주파수 천이량보다 월등히 크며, 이는 더 넓은 측정 영역 에서 절대 거리 측정이 가능하도록 해준다. PD1 에서는 기 준 신호를 얻고, PD2 에서 측정 신호를 얻어 그 두 신호의

위상 차가 일정하도록 위상 잠금 회로(Phase-locked loop, PLL)를 통해 제어하게 된다. 이 때 여러 합성파에 의한 거리 정보들이 PD 를 통해 한꺼번에 얻어지게 되므로 슈퍼헤테로다인(super heterodyne) 방법을 적용하여 원하는 주파수 성분, 즉 원하는 합성파를 통해 얻은 거리 정보를 얻어낸다.

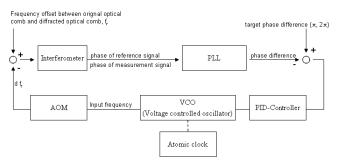


Fig. 2 Block diagram of phase-locking technique for absolute length metrology

그림 2 는 측정하고자 하는 절대 거리에 상응하는 AOM 의 주파수 변조량을 제어하여 위상 차를 유지시키면 서 그에 맞는 합성파를 생성하기 위한 제어 개념도이다. 초기 AOM 의 변조 주파수로 정해진 합성파로 간섭계 부분 을 통해 기준 파의 위상 성분과 측정 파의 위상 성분을 PD1과 PD2를 통해 각각 얻어낸다. PLL 회로를 통해 이 두 신호의 위상 차에 상응하는 DC 전압 값을 얻어내며, 이를 원하는 목표 위상 차(target phase difference)와의 차를 오차 신호로 정의하게 된다. 이 오차신호는 PID 제어기를 통해 매우 높은 주파수 안정도를 얻기 위해 Rb 원자 시계에 잠 금된 전압 제어 오실레이터(voltage controlled oscillator, VCO) 의 입력으로 들어가게 된다. 이 전압 오실레이터는 AOM 을 구동하는 변조 주파수 신호를 생성하며, 동시에 PD 를 통해 얻어진 많은 합성파 중에서 관심 있는 합성파 신호를 걸러내기 위해 사용되는 슈퍼 헤테로다인(super-heterodyne) 의 기준 주파수로도 사용된다. 이 제어신호를 통해 AOM 의 변조 주파수는 바뀌게 되고, 원래의 광 빗과 1 차 회절 된 광 빗 사이의 간섭에서 얻어지는 합성파 역시 바뀌게 된다. 간섭계를 통해 얻어지는 두 신호의 위상 차가 목표 위상 차로 수렴할 때까지 제어가 계속 수행되어지고, 측정 하고자 하는 절대 거리에 해당하는 AOM 의 변조 주파수가 수렴하면 이를 주파수 계수기로 읽어 내어 식(2)를 통해 절 대 거리, L 을 구해낼 수 있다. 일반적으로 위상 측정기의 분해능보다 주파수 계수기의 분해능이 훨씬 높기 때문에 nm 이하의 분해능을 얻어낼 수 있다.

3. 시뮬레이션

위상 잠금 기법을 적용하여 절대 거리 측정이 가능한지를 검증해보기 위해, 기준 거리가 0.1 m 이고 측정 거리가 10.1 m 라고 가정하고 본 연구에서 제안한 위상 잠금 개념을 바탕으로 시뮬레이션을 수행하였다. 초기 AOM 의 변조주파수는 30 MHz 로 두었고, 그림 2 의 증폭기(amplifier) 중하나를 반전 증폭기를 사용하여 목표 위상차가 π 인 경우를 고려하였다. 위상 차 오차, 즉 목표 위상 차와 실제 간섭계에서 얻어지는 위상 차의 차이가 10⁻¹⁰ 이하가 되면 위상 잠금을 통한 제어가 완료되었다고 가정하였다. 시뮬레이션 수행 결과는 그림 3 과 같으며 위상 차 오차는 0(10⁻¹⁰ 이하)으로 수렴함을 알 수 있고, AOM 의 변조 주파수 역시 15.0 MHz 로 수렴함을 알 수 있다. 이 때 수렴된 AOM 의 변조 주파수를 사용하여 식(2)를 통해 절대 거리를 구해보

면 10 m로 수렴함을 알 수 있다. 다양한 절대 거리에 따라 본 개념을 적용하는 경우 AOM 의 초기 변조 주파수에 따라 수렴의 속도나 수렴 정도가 정해지게 된다. 특히, 측정하고자 하는 거리, L 가 합성파의 한 파장, Λ 내에 있어야 위상의 모호성 없이 측정 가능하다. 이런 초기 위치를 선정하기 위해서 선형 연구로 진행된 펨토초 레이저 광 빗의주파수 모드를 통한 절대 거리 측정 방법을 적용하면, 최대 측정 거리인 60 m 이상의 거리도 측정 가능할 것이다. Table 1 은 주파수 모드간 간격에 따른 합성파의 파장이며, 최소 파장은 기본적인 펨토초 레이저의 주파수 모드인 80 MHz 에 해당하는 3.75 m 이고, 최대 파장은 5 MHz 에 해당하는 60 m 이다.

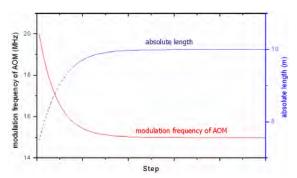


Fig. 3 Simulation result for absolute length of 10 m

Table 1 Synthetic wavelengths for each modulation frequency

Modulation Frequency of AOM (MHz)	Frequency shift between original and diffracted optical comb (MHz)	Synthetic wavelength
85 MHz	5 MHz	60 m
	75 MHz	4 m
100 MHz	20 MHz	15 m
	60 MHz	5 m
110 MHz	30 MHz	10 m
	50 MHz	6 m
120 MHz	40 MHz	7.5 m
Fundamental repetition rate, 80 MHz		3.75 m

4. 결론

본 논문에서는 최대 60 m 의 측정 거리에서 nm 이하의 분해능으로 측정할 수 있는 합성파 간섭계의 개념을 제안하고, 시뮬레이션으로 이를 검증하였다. 기존의 분해능이 낮은 위상 검출 방식을 위상 잠금 방식을 통해 AOM 의 변조 주파수를 측정함으로써 훨씬 높은 측정 분해능으로 절대 거리를 측정할 수 있었다. 동시에 펨토초 레이저의 높은 첨두 광량과 많은 주파수 모드들은 현재의 60 m 의 측정 거리를 확장시켜줌과 동시에 비선형 광학 원리를 기초로 하여 공기 굴절률 보상등의 가능성도 갖고 있다.

참고문헌

- J. Jin, Y,-J, Kim, Y. Kim, C.-S. Kang, S.-W. Kim, "Absolute length calibration of gauge blocks using optical comb of femtosecond pulse laser," Opt. Exp., 14(13), 5968-5974, 2006.
- 2. 김윤석, 진종한, 주기남, 김승우, "펨토초 레이저의 합성 파를 이용한 절대거리 측정," 한국정밀공학회 춘계학술 대회, 2005.